

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】令和4年4月1日(2022.4.1)

【公開番号】特開2021-3708(P2021-3708A)

【公開日】令和3年1月14日(2021.1.14)

【年通号数】公開・登録公報2021-002

【出願番号】特願2020-175145(P2020-175145)

【国際特許分類】

B 01 D 19/00(2006.01)

10

B 01 F 29/90(2022.01)

【F I】

B 01 D 19/00 102

B 01 D 19/00 101

B 01 F 9/22

【手続補正書】

【提出日】令和4年3月24日(2022.3.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

20

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

公転軸を中心に回転可能な公転体と、

公転体上の自転軸を中心に回転可能で、容器を保持可能な自転体と、
容器内の空気を吸引して容器内を真空状態にする真空手段とを備え、
真空手段は、

容器を密閉する密閉蓋と、

真空発生源と、

容器を始端として公転中心に向かい、公転中心を通って系外に抜け、系外に設置された真
空発生源に至る吸引経路と、

密閉蓋に設けられる真空計測手段とを備える

攪拌・脱泡装置。

30

【請求項2】

自転体は、内部が容器を収容する収容凹部となる周壁部を備え、

密閉蓋は、周壁部の端部に着脱自在に取り付けられて収容凹部を密閉する

請求項1に記載の攪拌・脱泡装置。

40

【請求項3】

吸引経路の始端は、自転体の周壁部の内面に位置し、

真空計測手段は、密閉蓋の外周部を除く中心領域に配置される

請求項2に記載の攪拌・脱泡装置。

【請求項4】

真空計測手段は、密閉蓋の外面側に配置され、

真空計測手段のポートは、密閉蓋を貫通して収容凹部内の容器の開口部付近に位置する

請求項2又は請求項3に記載の攪拌・脱泡装置。

【請求項5】

真空計測手段は、密閉蓋の内面側に配置され、

真空計測手段のポートは、収容凹部内の容器の開口部付近に位置する

50

請求項 2 又は請求項 3 に記載の攪拌・脱泡装置。

【請求項 6】

密閉蓋に通孔が形成されるとともに、通孔を覆うようにカバーが密閉蓋の外面に着脱自在に取り付けられ、

真空計測手段は、カバーの内部空間に配置される

請求項 2 又は請求項 3 に記載の攪拌・脱泡装置。

【請求項 7】

カバーが密閉蓋の内面に着脱自在に取り付けられるとともに、カバーに通孔が形成され、

真空計測手段は、カバーの内部空間に配置される

請求項 2 又は請求項 3 に記載の攪拌・脱泡装置。

10

【請求項 8】

真空計測手段は、電源を内蔵し、かつ、無線通信機能を有する

請求項 1 ないし請求項 7 のいずれか 1 項に記載の攪拌・脱泡装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

また、本発明に係る攪拌・脱泡装置は、

公転軸を中心に回転可能な公転体と、

公転体上の自転軸を中心に回転可能で、容器を保持可能な自転体と、

容器内の空気を吸引して容器内を真空状態にする真空手段とを備え、

真空手段は、

容器を密閉する密閉蓋と、

真空発生源と、

容器を始端として公転中心に向かい、公転中心を通って系外に抜け、系外に設置された真空発生源に至る吸引経路と、

密閉蓋に設けられる真空計測手段とを備える

攪拌・脱泡装置である。

20

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

ここで、本発明に係る攪拌・脱泡装置の一態様として、

自転体は、内部が容器を収容する収容凹部となる周壁部を備え、

密閉蓋は、周壁部の端部に着脱自在に取り付けられて収容凹部を密閉する

との構成を採用することができる。

40

また、この場合、

吸引経路の始端は、自転体の周壁部の内面に位置し、

真空計測手段は、密閉蓋の外周部を除く中心領域に配置される

との構成を採用することができる。

また、これらの場合、

真空計測手段は、密閉蓋の外側に配置され、

真空計測手段のポートは、密閉蓋を貫通して収容凹部内の容器の開口部付近に位置する

との構成を採用することができる。

あるいは、

真空計測手段は、密閉蓋の内面側に配置され、

50

真空計測手段のポートは、収容凹部内の容器の開口部付近に位置する
との構成を採用することができる。

あるいは、

密閉蓋に通孔が形成されるとともに、通孔を覆うようにカバーが密閉蓋の外面に着脱自在
に取り付けられ、

真空計測手段は、カバーの内部空間に配置される
との構成を採用することができる。

あるいは、

カバーが密閉蓋の内面に着脱自在に取り付けられるとともに、カバーに通孔が形成され、

真空計測手段は、カバーの内部空間に配置される
との構成を採用することができる。

10

20

30

40

50